

UV ナノインプリンター ImpFlex ImpFlex Essential

精密転写装置 低残膜・低バブル

ナノインプリント装置 ImpFlex は独立行政法人 産業技術総合研究所 工学博士 廣島 洋 先生の研究に基づく特許使用と共同研究により製品化しました。

15kV X1,000 10µm 0000 15 30 SEI

大気中プロセス

15kV X1,000 10µm 0000 15 30 SEI

バブル消去ガス使用

Flexible Thruster linear actuator linear actuator (flexible pad) (for mold table)

UVナノインプリントステッパー
ImpFlex

UVナノインプリンター
ImpFlex-Essential

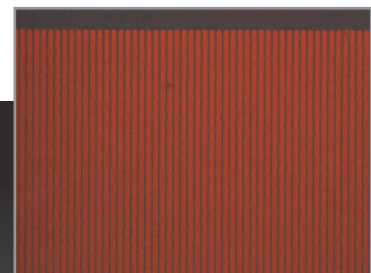
オンリーワンの SOFT ステージ

α β 角度姿勢制御、精密な圧力制御機能を持つモールドテーブル

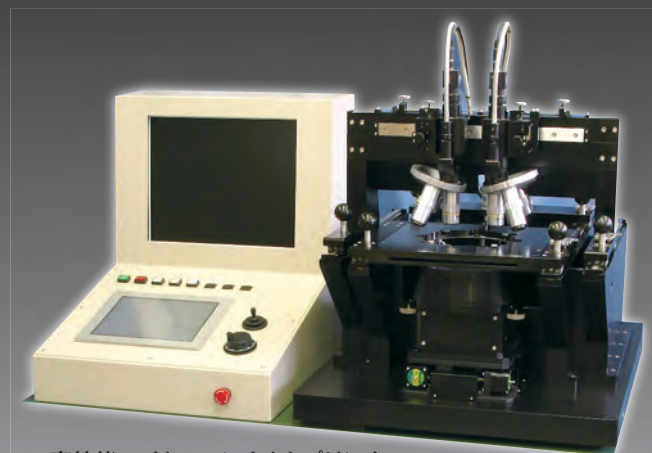
マイクロコンタクトプリンター MP200 PA400 series

次世代デバイス製作手法として注目を集める mCP 法に対応する装置です。

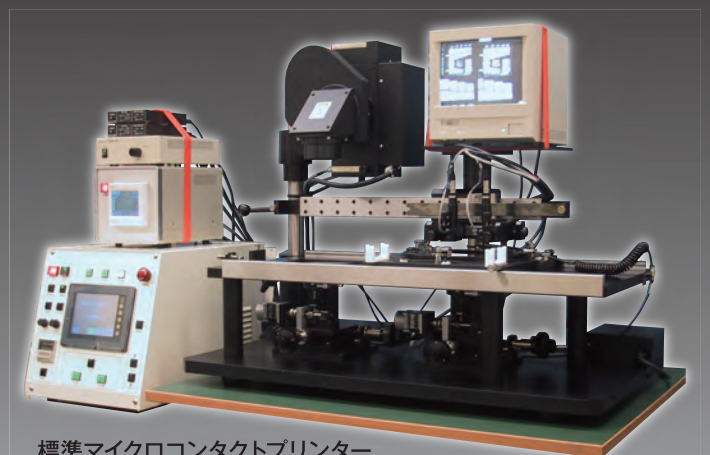
有機エレクトロニクス分野やバイオ用マイクロ構造体などを、PDMS スタンプによるインク転写によって製作します。



Line 4µm、Space 2µm サンプル



高性能マイクロコンタクトプリンター
MP200



標準マイクロコンタクトプリンター
PA400s

注：マイクロコンタクトプリンターは独立行政法人 産業技術総合研究所との共同研究等によるものではありません。

外観自動検査装置



1 μ サイズの異物、欠損、キズ、ムラの自動検出

多様化する産業界の各種製品のパネル基板やフィルム、半導体部品の微小欠陥を最新のラインセンサ外観検査システムで検査します。

最新の光アライアンス技術によりメカニカル・オプティカル画像処理を融合し独自の高速／高精度検査機を提案します。この外観検査機はマイクロからマクロまでの検査ユニットを搭載して各種検査への対応と、複合機能で検査とレビューや加工、調整などのユニットを目的に合わせて構築することができます。

300mmまでのワークに対応し、光源の選択や設置方法により、明視野・暗視野・偏光透過などの各種観察方式に対応し、1 μ サイズの異物、欠損、キズ、ムラなどを自動的に検出することが可能です。ACサーボモータによる駆動により精度の高いマッピングデータと欠陥リストの生成が可能となり、観察ポイントへの高速で精度の高い位置決めを可能としています。

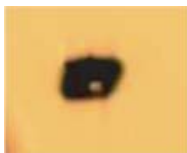
レビュー画面



暗視野透過観察



明視野反射観察



明視野透過観



偏光透過観察

機能

- ・サーチ検査およびデータ管理、システム制御
- ・レビュー機能、画像ファイル機能、複数同時検査が可能

	項目	仕様
オートステージ	ストローク	320mm(X) × 320mm(Y) × 20mm(Z)
	繰返し精度	1 μ m
	最大速度	200mm/sec
	ワーク搭載サイズ	320mm口
	Z軸フォーカス	1 μ m単位駆動
	駆動方式(XYZ)	ACサーボモータによるボールネジ駆動
検査部	観察方式	明視野・暗視野・偏光透過に対応
	サーチ性能	標準 5倍 分解能 5 μ m 高精度 10倍 分解能 2.5 μ m
	スキャンスピード	100mm/sec(標準) 50mm/sec(高精度)
	レビュー検査	対物5、10、20倍、カラーカメラ 付属
その他	付属品	安全カバー PC、ディスプレイ、画像処理ボード UPS電源 照明制御ユニット
	オプション	FFU

お問い合わせ先: y-inuzuka@sanmei.co.jp

総発売元 **株式会社三明**

本社 〒424-0825 静岡県静岡市清水松原町6-16
電話: 054(353)3271 FAX: 054(352)1648

製造元 **三明電子産業株式会社**

住所 〒424-0923 静岡県静岡市清水区幸町9-26
電話: 054(335)5588 FAX: 054(335)5724